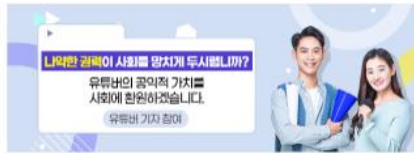




(Korea)

### EV Group announces multi-functional micro- and nanoimprint solution 'EVG7300' offering flexibility for high-volume optical device manufacturing - January 19, 2022

EVG introduced the EVG@7300 automated SmartNIL® nanoimprint and wafer-level optics system. Supporting wafer sizes up to 300 mm and featuring high-precision alignment, advanced process control and high throughput, the EVG7300 meets the high-volume manufacturing needs for a variety of freeform and high-precision nano- and micro-optical components and devices. The EVG7300 system is offered as both a stand-alone tool as well as an integrated module in EVG's HERCULES® NIL fully integrated UV-NIL track solution where additional pre-processing steps, such as cleaning, resist coating and baking or post-processing, can be added to optimize for particular process needs. Quick loading of stamps and wafers, fast alignment optics, high-power curing and a small tool footprint enable a highly efficient platform capable of serving the industry's manufacturing needs for emerging WLO products.



EV 그룹, 대량생산 광학 기기 제조용으로 뛰어난 유연성 제공하는 다기능 마이크로나노임프린트 솔루션 'EVG@7300' 출시

최정원기자@kja4719@naver.com | 승인 2022.01.19 15:55 | 9면 9



나노임프린트 리소그래피(NIL) 렌즈 돌림 및 렌즈 스테칭(UV 불링) 후 UV 기판의 여러 공정을 단일 플랫폼에 결합한 EVG의 최첨단 솔루션

[뉴스포털]=정원기자 MEMS 나노 기술 반도체 제조용 웨이퍼 돌림 및 리소그래피 장비의 선조적 공급사인 EV 그룹(이하 EVG)이 자동화된 SmartNIL® 나노임프린트 및 웨이퍼 레벨 광학 시스템인 EVG@7300을 출시한다고 19일 밝혔다.

EVG의 최신 솔루션인 EVG7300은 나노임프린트 리소그래피(NIL) 렌즈 돌림 및 렌즈 스테칭(UV 불링) 같은 UV 기판의 여러 프로세스를 단일 플랫폼에 결합한 것이 특징이다. 이 산업용 다기능 시스템은 마이크로 및 나노 패터닝은 물론, 기능 레이어 적층 등을 포함하는 광범위한 신규 애플리케이션의 첨단 R&D와 생산 공정 모두에 사용될 수 있다.



EV 그룹의 다기능 마이크로 및 나노노드르츠 솔루션 EVG7300을 출시했다-사진제공

이런 애플리케이션의 사례에는 웨이퍼 레벨 광학(WLO), 결합 렌서와 프리즘, 차량용 조경 중앙 현상(AR) 헤드셋용 웨이브가이드 바이오 의료 장비, 메타 렌즈와 메타 표면 광전자 기기 등이 포함된다. 최대 300mm 웨이퍼까지 지원하고 고정밀 열라민으로 향상된 프로세스 제어, 우수한 스루풋 성능을 자랑하는 EVG7300은 다양한 자유도와 높은 정밀도로 나노 및 마이크로 광학 부품과 기기를 대량 생산하려는 사용자의 요구를 충족한다.



- +강태웅 +고관성 +고영준 +고영찬
- +강현구 +고광여 +고영도 +고영향
- +강효진 +고광문 +고영창 +고요주
- +강희준 +고국현 +고영문 +고영웅
- +강현우 +고나희 +고영문 +고영홍



국민기자교육센터 무엇이 바뀌어야?

EV 그룹의 토마스 글린스너(Thomas Glinsner) 기술담당 디렉터는 "나노임프린트 기술에 있어 20년 이상의 경험을 보유한 EV 그룹은 고객의 변화하는 요구를 충족하기 위해 지속적인 기술 혁신을 통해 더 나은 솔루션을 제공하고 있다. 최신 나노임프린트 솔루션인 EVG7300은 EVG 고유의 SmartNIL 플레이트 임프린트 기술에 렌즈 플팅과 렌즈 스타킹을 단일 플랫폼에 결합하고 있으며, 시장에서 가장 정밀한 얼라인먼트와 공정 파라미터 제어가 특징인 시스템으로서 고객이 연구개발과 양산 공정 모두에 사용할 수 있도록 유례없는 유연성을 제공한다"고 말했다.

EVG7300은 독립된 플랫폼 사용하거나 EVG의 HERCULES® UV-NIL 트랙 솔루션에 하나의 모듈로 통합해 사용할 수 있다. EVG의 HERCULES® UV-NIL 트랙 솔루션은 사용자의 특정 프로세스 요건에 따라 세팅과 레지스트 코팅 및 베이킹 같은 전처리 공정이나 후처리 공정을 추가할 수 있다. 또한 EVG7300은 업계 선도적인 얼라인먼트 정확도를 제공한다(300nm까지). 이는 향상된 얼라인먼트 스테이지, 고정밀 광학계, 멀티포인트 갭 제어, 비접촉식 갭 측정, 멀티포인트 포스 제어 등 다양한 방법의 조합 덕분에 가능해졌다.

또한 EVG7300은 유연성이 매우 뛰어난 플랫폼으로서 세 가지 공정 모드(렌즈 플팅, 렌즈 스타킹, SmartNIL 나노임프린트)를 지원하고, 150mm부터 300mm까지 이르는 웨이퍼 크기를 지원한다. EVG7300은 신속한 스왑아웃 웨이퍼 로딩, 고속 얼라인먼트 광학계, 고전력 경화, 소형화된 플랫폼으로 업계에서 새롭게 떠오르는 WLO 제품의 제조 요구를 충족하는 매우 효율적인 플랫폼을 제공한다.

EVG는 현재 이 시스템의 주문을 받고 있으며, EVG 본사에 위치한 NILPhotonics® 역량 센터에서 이 제품의 데모도 시연하고 있다. EVG7300 자동화 SmartNIL 나노임프린트 및 웨이퍼 레벨 광학계에 대한 추가 정보는 홈페이지에서 확인할 수 있다.

EV 그룹(EVG)은 반도체, MEMS, 화합물 반도체, 파워 디바이스 그리고 나노 기술을 이용한 소자들을 제조하는데 필요한 장비 및 공정 솔루션을 제공하는 세계적인 전문 기업이다. 웨이퍼 본딩, 얇은 웨이퍼 처리 기술(TWHS), 리소그래피 / 나노 임프린트 리소그래피(NIL) 및 계측기기를 포함한 주요 제품 이외에도 프트 레지스트 코터, 웨이퍼 세정장비 및 검사 시스템을 제조 생산하고 있다. 1980년 설립된 EV 그룹은 글로벌 고객들과 파트너들을 위한 서비스와 협력지원을 위해 정교한 네트워크를 구축해 놓고 있다. EVG에 대한 보다 더 자세한 정보는 웹사이트에서 확인할 수 있다.

<http://www.civilreporter.co.kr/news/articleView.html?idxno=90248>